厳密な光波遮蔽法の 高解像度計算機合成ホログラムへの適用 Rigorous Light-Shielding for High-Definition Computer Holography

增田幸勇¹ 松島恭治¹ 中原住雄² Sachio Masuda¹ Kyoji Matsushima¹ Sumio Nakahara²

1 関西大学 システム理工学部 電気電子情報工学科

¹Department of Electrical and Electronic Engineering, Kansai University

²関西大学 システム理工学部 機械工学科

²Department of Mechanical Engineering, Kansai University

ABSTRACT

In high-definition (HD) computer holography, the silhouette method plays an important role to shield light behind objects and prevent the objects from being reconstructed as see-through images. Furthermore, the switch-back method has been proposed to speed-up the silhouette light-shielding polygon by polygon. However, since HD-CGHs has very high physical resolution and thus large diffraction angles, off-axis light is sometimes not shielded by the silhouette masks and causes leakage light and occlusion errors. To remove the leakage light generally caused in the silhouette method, another technique has been already proposed for more rigorous light-shielding. However, this rigorous technique has never been applied to HD-CGHs, because the rotational transform required in the rigorous technique is very time-consuming in HD computer holography. In this paper, a new technique is proposed for applying the rigorous light-shielding to HD computer holography and verified by simulated reconstruction of the object field calculated by the proposed technique.

Keywords: computer holography, computer-generated hologram, hidden-surface removal

1. はじめに

近年のアルゴリズム,コンピュータ,微細加工技術の発展により,光波の回折と干渉をシミュレート してホログラムの干渉縞パターンを数値的に求め, 描画することが可能となった.この技術はコンピュ ータホログラフィと呼ばれ[1],次世代のデジタル 3D 技術として注目されている.この技術により作成 されたホログラムは計算機合成ホログラム (Computer-Generated Hologram: CGH)と呼ばれ,レー ザーリソグラフィ技術とポリゴン法[2]に基づく高 解像度 CGH では古典的なホログラムに匹敵するほ どの美しい空間像が再生できる[3, 4].

現状の高解像度コンピュータホログラフィでは, 後方からの光波が前方の物体に透けないようにする 光波遮蔽処理として,シルエット法が用いられてい る[5,6].シルエット法とは,物体のシルエットをホ

増田幸勇

<masuda@laser.ee.kansai-u.ac.jp> 関西大学システム理工学部電気電子情報工学科 〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35 TEL 06-6368-1121(内線 5722) ログラムと平行な平面に投影したマスクを用いて光 波を遮蔽する近似的手法である.シルエット法をポ リゴン単位で用いた場合は,自己オクルージョンを 処理できるため,バビネの原理と部分光波伝搬を用 いてポリゴン単位シルエット法を高速に処理できる スイッチバック法が提案されている[7].しかし高解 像度 CGH では,最大回折角が大きいため,シルエ ットマスク間を通り抜ける軸はずれ光波が生じ,オ クルージョンエラーが生じる問題があった[6,8].

一方,このような軸外れ光波も除去できる厳密な 光波遮蔽法も提案されている[9].この手法では,ポ リゴンと同一平面上での光波分布を回転変換[10, 11]を用いて計算し,ポリゴン形状のマスクで遮蔽す る.そのため原理的に光波の漏れは発生しない.し かし高解像度 CGH においては光波全体の回転変換 の計算コストが非常に高いため,高解像度 CGH に 対してこの手法が用いられたことはなかった.

そこで本研究では、厳密な光波遮蔽を高解像度 CGH に適用しスイッチバック法によって隠面消去 するための手法を提案する.

2. 厳密な光波遮蔽法[9]

この手法では、ポリゴンが存在する平面上で背 景光波をポリゴン自身で遮蔽するため、原理的にオ クルージョンエラーは起こらない.この処理を実現 するには、ホログラムと平行な平面上での光波分布 である背景光波を回転変換し、傾いたポリゴン平面 上での背景光波を求める必要がある.以下、回転変 換の手順を要約する.

2.1 光波の回転変換

座標系 $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ の平面 $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z} = 0)$ で与えられる光 波を $\hat{h}(\hat{x}, \hat{y})$ とし、この座標系と原点を共有する傾い た座標系 (x, y, z)の平面 (x, y, z=0での光波は h(x, y)で表されるとする.以下では、 $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z} = 0)$ を 平行平面、(x, y, z=0)を傾いた平面と呼ぶ.このと き回転変換は、

$$h(x, y) = \operatorname{Rot}\left\{\hat{h}(\hat{x}, \hat{y})\right\}$$
$$= F^{-1}\left\{R\left\{F\{\hat{h}(\hat{x}, \hat{y})\}\right\}\right\}$$
(1)

と表される.ここで F{ }はフーリエ変換であり,

$$\hat{H}(\hat{u}, \hat{v}) = F\{\hat{h}(\hat{x}, \hat{y})\}$$
 (2)

とする.ここで, (\hat{u}, \hat{v}) と(u, v) はそれぞれ平行平面 と傾いた平面での空間周波数である.二つの座標系 の間の回転変換行列を,

$$\begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \\ \hat{z} \end{pmatrix} = \mathbf{T} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \mathbf{T} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{pmatrix}$$
(3)

とすると、フーリエ空間での座標回転演算 R{ }は、

$$R\{\hat{H}(\hat{u},\hat{v})\}$$

= $\hat{H}(a_1u + a_2v + a_3w(u,v), a_4u + a_5v + a_6w(u,v)) (4)$
= $H(u,v)$

と表される. ここで $w(u,v) = \sqrt{\lambda^{-2} - u^2 - v^2}$ は傾いた 平面に垂直な*z*方向の空間周波数であり, H(u,v)は 傾いた平面上での光波スペクトルである. 最終的に 傾いた平面上の光波分布は逆フーリエ変換を用いて,

$$h(x, y) = F^{-1}\{H(u, v)\}$$
(5)

で与えられる.

2.2 傾いた平面での遮蔽処理

Fig.1 にポリゴンによる背景光波の遮蔽手順を示 す.光波遮蔽のためのマスク関数は、ポリゴンの存 在する傾いた平面上で乗算する必要がある.そのた め、上述の光波 $\hat{h}(\hat{x},\hat{y})$ を背景光波とし、(a)に示すよ うに、回転変換により傾いた平面上での背景光波を 計算する.従って、ポリゴン形状マスクによる遮蔽 処理は、

$$h'(x, y) = \operatorname{Rot}\{\hat{h}(\hat{x}, \hat{y})\} \times m(x, y)$$
(6)



Figure 1. The procedure for rigorous light-sheilding.

と表される. ここでマスク関数m(x, y)は傾いた平面上での2値関数であり,

$$m(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{inside polygon} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$
(7)

と定義する.(c)に示すように、平行平面における遮蔽された背景光波は逆回転変換によって求められる.

$$\hat{h}'(\hat{x}, \hat{y}) = \operatorname{Rot}^{-1} \{ h'(x, y) \}$$

= $\operatorname{Rot}^{-1} \{ \operatorname{Rot} \{ \hat{h}(\hat{x}, \hat{y}) \} \times m(x, y) \}$ (8)

3. 厳密な遮蔽処理の高解像度 CGH への適用

以上のように、厳密な光波遮蔽は2回の回転変換 を必要とするため、数億のサンプリング点を持つ高 解像度 CGH では計算コストが非常に大きくなる. 本研究では、その計算コストを削減するために以下 に示す手法を用いている.

3.1背景光波のクリッピング

一般にポリゴンは背景光波よりもはるかに小さい ため、ポリゴンによって遮蔽される部分は背景光波 のほんの一部である.従って、背景光波全体ではな く、必要な範囲のみクリッピングして回転変換を行 うことで、計算コストの削減が可能となる.ここで、 背景光波の必要な範囲とは、ポリゴンに入射し光波 遮蔽によって影響を受ける部分である.本研究では Fig.2に示すように、この範囲をポリゴンからの光波 の最大回折範囲としている.最大回折範囲はポリゴ ンの頂点座標と、背景光波のサンプリング間隔で決 まる最大回折角θ_{max}で決定される範囲である[3].



Figure 2. Clipping area of the background field.

3.2スイッチバック法で必要なサンプリング範囲

Fig.3 に示すように、傾いた平面でのサンプリング 範囲はクリッピングした部分の背景光波が回折する 範囲を全て含んでいる必要がある.これはクリップ した光波の情報喪失を防ぐためであるが、ポリゴン が平行平面に対して大きな傾き φを持つ場合では、 このサンプリング範囲は非常に大きくなり、無限大 になる場合もある.しかし本研究では、遮蔽処理手 順としてスイッチバック法を用いているため、この 問題が生じない[7].

これは、スイッチバック法では Babinet の原理に 基づいて遮蔽処理を行うため、Fig.4 に示すように、 光波遮蔽を(a)に示すマスクではなく、(b)に示す開口 を用いて行うためである.これにより傾いた平面で 必要な光波は開口に入射する部分のみに限定される ため、回折光波全体を計算する必要がなくなる.

3.3逆回転処理の最適化

Fig.5 は回転変換によるフーリエ空間でのサンプ リング領域の推移を示す. (a)に示すように,FFT を 用いるためフーリエ空間でのサンプリング領域の形 状は矩形となる.しかしながら,(b)に示すように, (4)式の座標回転演算 R }によりこのサンプリング 領域は歪み,スペクトルH(u,v)は大きくシフトする. これをそのまま逆 FFT するのは効率が悪いため,回 転変換ではシフト座標系,

$$(\tilde{u}, \tilde{v}) = (u - u_0, v - v_0) \tag{9}$$

を導入している.ここで、 $(u_0,v_0) = (a_7 / \lambda, a_8 / \lambda)$ である.従って、傾いた平面での光波は次のように表される[10].

$$h(x, y) = F^{-1}\{H(\tilde{u}, \tilde{v})\} \exp[i2\pi(u_0 x + v_0 y)] \quad (10)$$

その結果, (c)に示すようにスペクトル $\hat{H}(\tilde{u},\tilde{v})$ は原点 付近に位置するが,光波h(x,y)にはキャリア成分で ある平面波因子が生じ,これを含めて処理しなけれ ばならない.しかしこの平面波因子は非常に高い空 間周波数となる問題点がある.そこで,本研究では スペクトル $\tilde{H}(\tilde{u},\tilde{v})$ の逆フーリエ変換 $F^{-1}{\tilde{H}(\tilde{u},\tilde{v})}$ について,



Figure 3. The sampling window required for avoiding information loss in the the tilted plane.





$$\tilde{h}'(x, y) = F^{-1}\{\tilde{H}(\tilde{u}, \tilde{v})\} \times m(x, y)$$
(11)

として遮蔽処理する.省略した平面波因子は逆回転 変換のフーリエ変換で復活し,

$$F\{h'(x, y)\} = F\{h'(x, y)\exp[i2\pi(u_0x + v_0y)]\}$$
(12)
= H'(u+u_0, v+v_0),

とする.ここで, $H'(u,v) = F\{\tilde{h}'(x,y)\}$ である.これ により高周波のキャリア成分を直接扱うことなく, シフト処理のみで計算ができる.(e)のシフトしたス



Figure 5. Transition of sampling area in Fourier apace.





ペクトルは,実際には(f)に示すように,逆座標回転 演算 R⁻¹{}により2回目のFFT に適した矩形サンプ リング領域に復元する.

また, Fig.6 に示すように,回転角が大きい場合, フーリエ空間におけるサンプリング範囲は大きく変 形する.そこで本研究では,Fig.6(a)に示すように, FFT によって与えられる初期状態のサンプリング領 域に 50×50 の代表点を設定し,回転変換によるこれ らの点群の位置を追跡し,全代表点を含む最小限の 範囲をサンプリングする範囲としている.

4. 提案手法による光波遮蔽の効果

提案手法の有効性の確認するため, Fig.7 に示す 3D シーンの光波を計算した.物体は 140 ポリゴンの 円環体である.光波は,サンプリング数 65,536× 65,536,サンプリング間隔 1 µm である.従来のスイッチ バック法と提案法で数値合成した光波の結像再生シミ ュレーションを Fig.8 に示す.この結果より,提案法によ る漏れ光波の減少を確認できる.

5. まとめ

高解像度のコンピュータホログラフィにおいて厳 密な光波遮蔽法を適用する手法を提案した.この手 法を用いた場合,遮蔽漏れ光波やオクルージョンエ ラーを低減できることが確認できた.



Figure 7. The 3D scene used for the examination of light-shielding.

謝辞

本研究は、日本学術支援振興会の科研費 (24500133),および平成23年度関西大学学術研究助 成金(共同研究)の助成を受けたものである.

参考文献

- K. Matsushima, H. Nishi, and S. Nakahara, "Simple wave-field rendering for photorealistic reconstruction in polygon-based high-definition computer holography," J. Electron. Imaging 21, 023002 (2012).
- [2] K. Matsushima, "Computer-Generated Holograms for Three-Dimensional Surface Objects with Shade and Texture," Appl. Opt. 44, 4607-4614(2005).
- [3] K. Matsushima, and S. Nakahara, "Extremely High-Definition Full-Parallax Computer-Generated Hologram Created by the Polygon-Based Method," Appl. Opt. 48, H54-H63 (2009).
- [4] K. Matsushima, and S. Nakahara, "Stepping closer to the perfect 3D digital image," SPIE Newsroom, (6 Nov. 2012). DOI:10.1117/2.1201210.004526.
- [5] K. Matsushima, and A. Kondoh, "A Wave Optical Algorithm for Hidden-Surface Removal in Digitally Synthetic Full-Parallax Holograms for Three-Dimensional Objects," SPIE Proc. 5290, 90-97(2004).
- [6] A. Kondoh, and K. Matsushima, "Hidden Surface Removal in Full-Parallax CGHs by Using the Silhouette Approximation," The Institute of Electronics, Information and Communication Enggineers J87-D-II, 1487-1494(2004).
- [7] 中村将樹,松島恭治,中原住雄,"全方向視差 CGH における ポリゴン単位の高速隠面消去法,"3次元画像コンファレン ス,66-69(2011).
- [8] K. Matsushima, Y. Arima, and S. Nakahara, "Digitized holography: modern holography for 3D imaging of virtual and real objects," Appl. Opt. 50, Iss 34, H278-H284 (2011).
- K. Matsushima, "Exact Hidden-Surface Removal in Digitally Synthetic Full-Parallax Holograms," SPIE Proc. 5742, 25-32(2005).
- [10] K. Matsushima, "Formulation of the Rotational Transformation of Wave Fields and Their Application to Digital Holography," Appl. Opt. 47, D110-D116 (2008).
- [11] K. Matsushima, H. Schimmel, and F. Wyrowski, "Fast Calculation Method for Optical Diffraction on Tilted Planes Using the Angular Spectrum of Plane Waves," Journal of the Optical Soceity of America A20, 1755-1762 (2003).
- [12] 中村将樹,松島恭治,中原住雄,"超高解像度 CGH における Babinet の原理と部分光波伝搬を用いた隠面消去法,"映情学 誌 66,5,J136-J143 (2012).





(a) Conventional silhouette method

(b) This work

Figure 8. Comparison of two light-shielding techniques.